

>> 특집

옵토메카트로닉스 계측 기술 로드맵(II)

본 고는 사단법인 일본기계공업연합회 및 일본옵토메카트로닉스협회에서 2003년도 3월에 발행한 “옵토메카트로닉스 로드맵 작성 조사연구보고서(정밀가공 및 계측요소기술)”로서 국내 광학산업 발전에 도움이 되고자 한국광학기기 협회에서 일부 자료를 번역한 것이다. 3월호의 정밀가공 기술로드맵에 이어 5월호와 7월호에서는 계측요소기술 로드맵을 2회 나누어 게재한다.

|편집자 주|

52 >> > 고속 광 표면 형상 계측

59 >> > 레이저 기입 광학계용 광학 장치의 계측

70 >> > 광 간섭 계측